

Imagens obtidas por microscopia óptica e eletrônica de varredura dos filmes irradiados por elétrons.

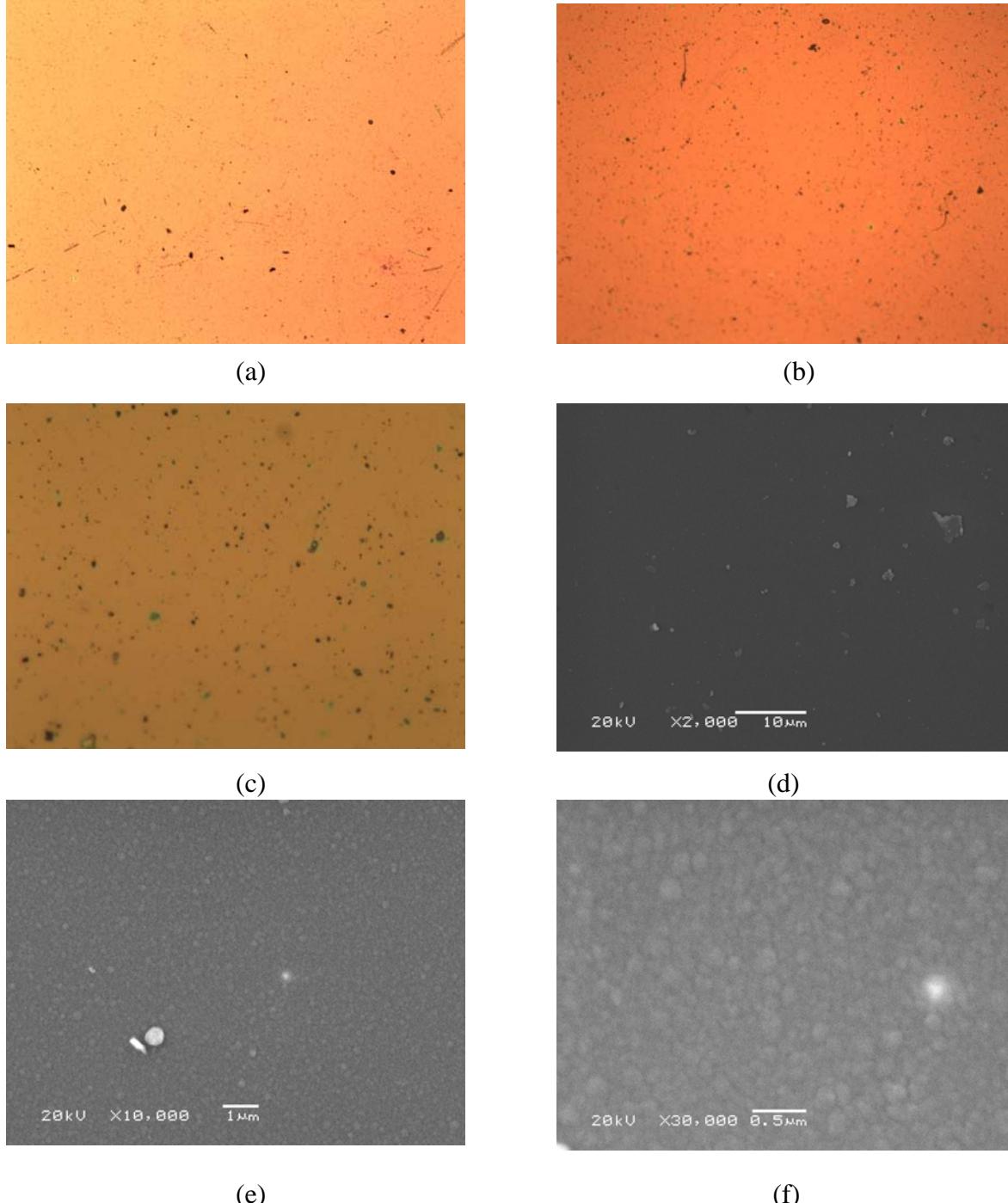


Figura A.2.1 - Imagens da amostra 9, obtidas pelas técnicas de microscopia óptica: (a) 50x; (b) 200x; (c) 1000x. E eletrônica: (d) 2000x; (e) 10000x; (f) 30000x

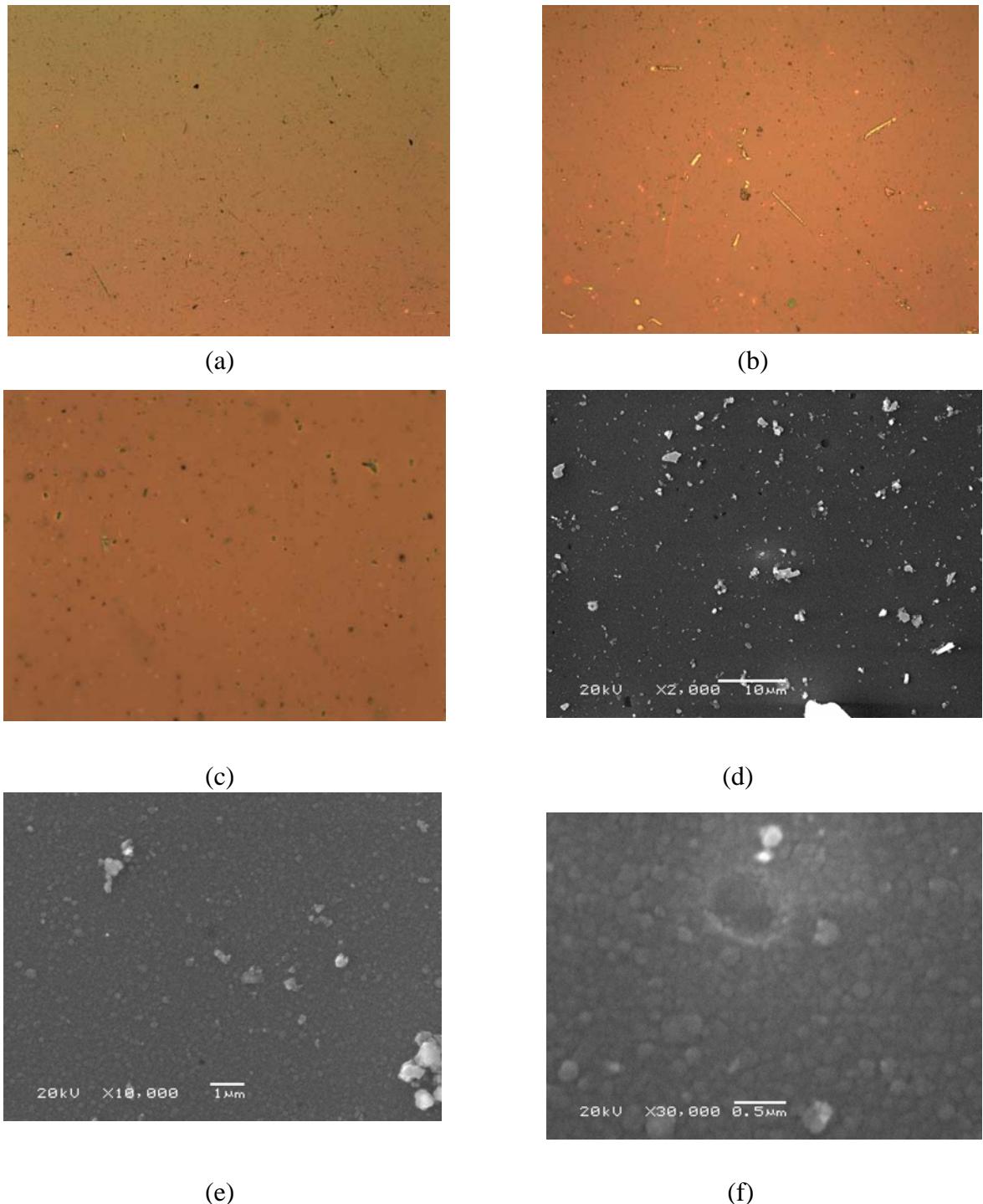


Figura A.2.2 - Imagens da amostra 10, obtidas pelas técnicas de microscopia óptica: (a) 50x; (b) 200x; (c) 1000x. E eletrônica: (d) 2000x; (e) 10000x; (f) 30000x

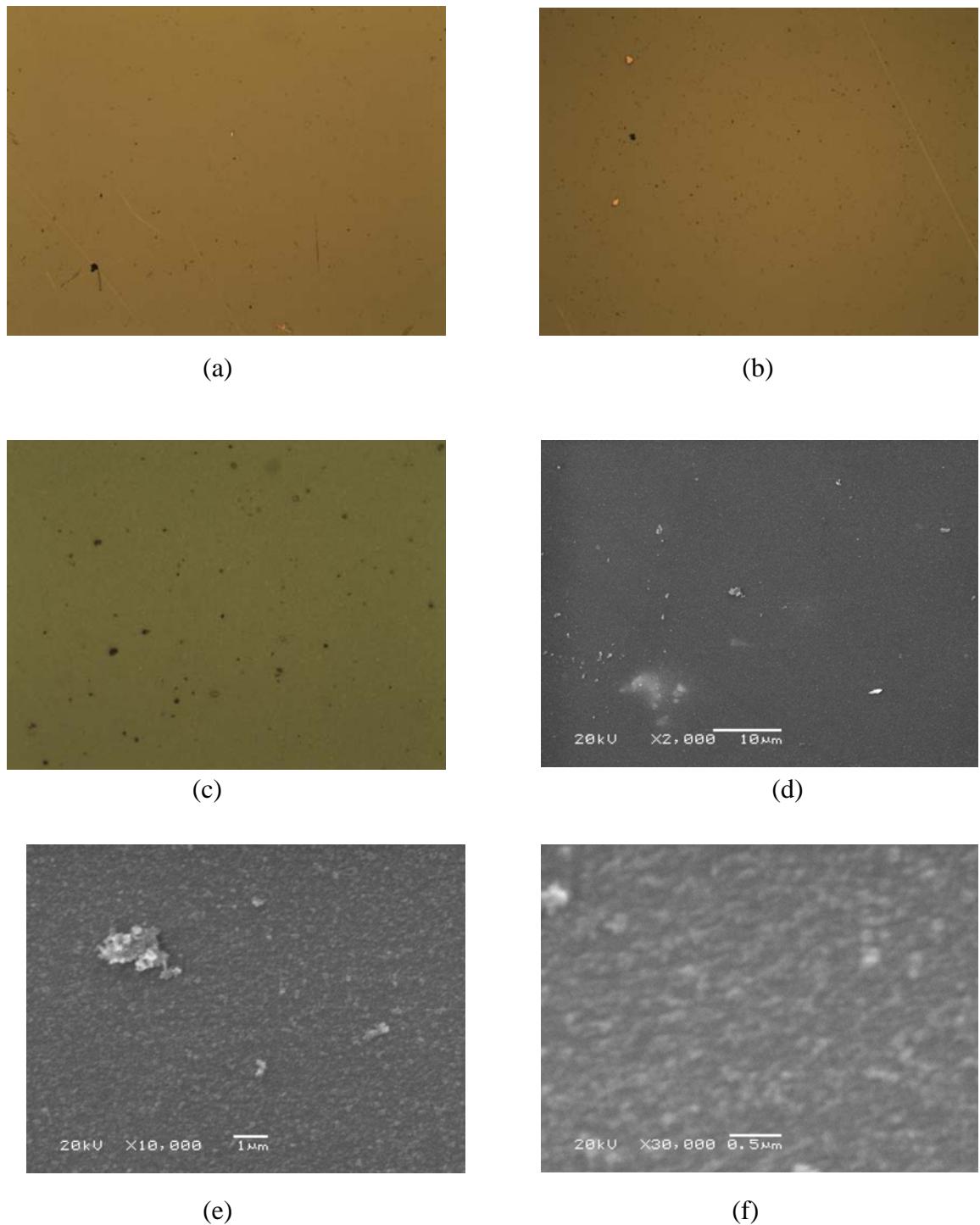


Figura A.2.3 - Imagens da amostra 23, obtidas pelas técnicas de microscopia óptica: (a) 50x; (b) 200x; (c) 1000x. E eletrônica: (d) 2000x; (e) 10000x; (f) 30000x

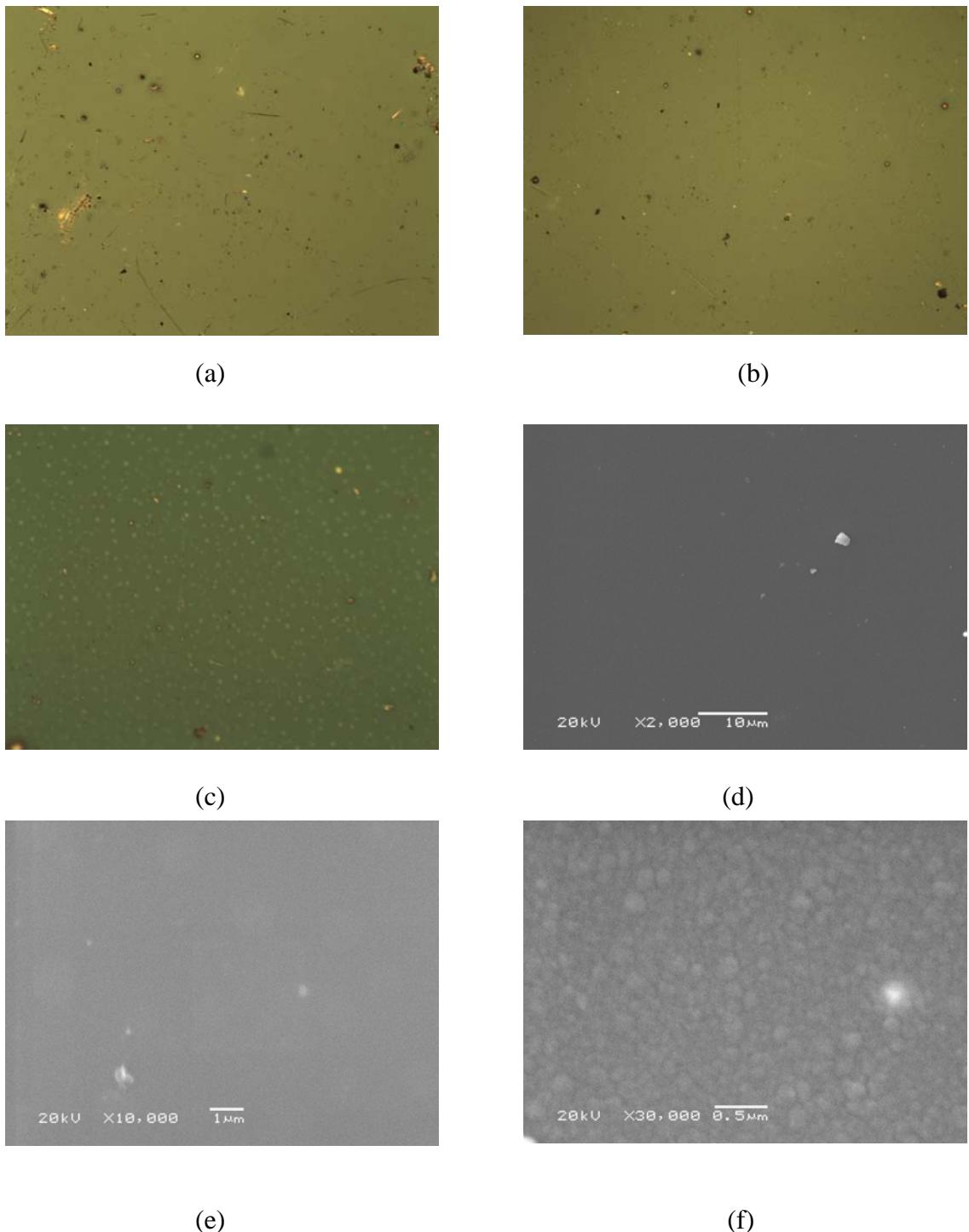


Figura A.2.4 - Imagens da amostra 26, obtidas pelas técnicas de microscopia óptica: (a) 50x; (b) 200x; (c) 1000x. E eletrônica: (d) 2000x; (e) 10000x; (f) 30000x

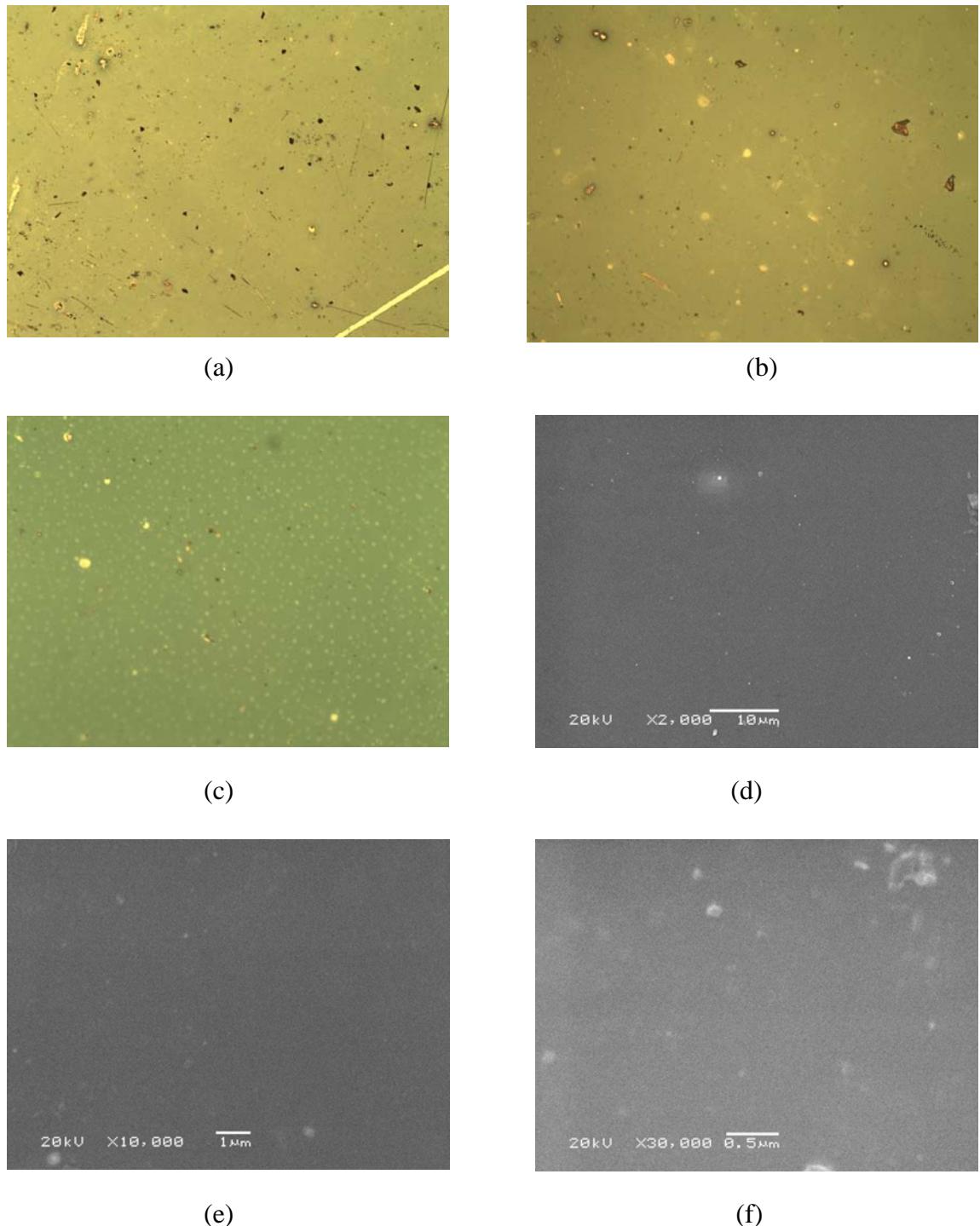


Figura A.2.5 - Imagens da amostra 27, obtidas pelas técnicas de microscopia óptica: (a) 50x; (b) 200x; (c) 1000x. E eletrônica: (d) 2000x; (e) 10000x; (f) 30000x

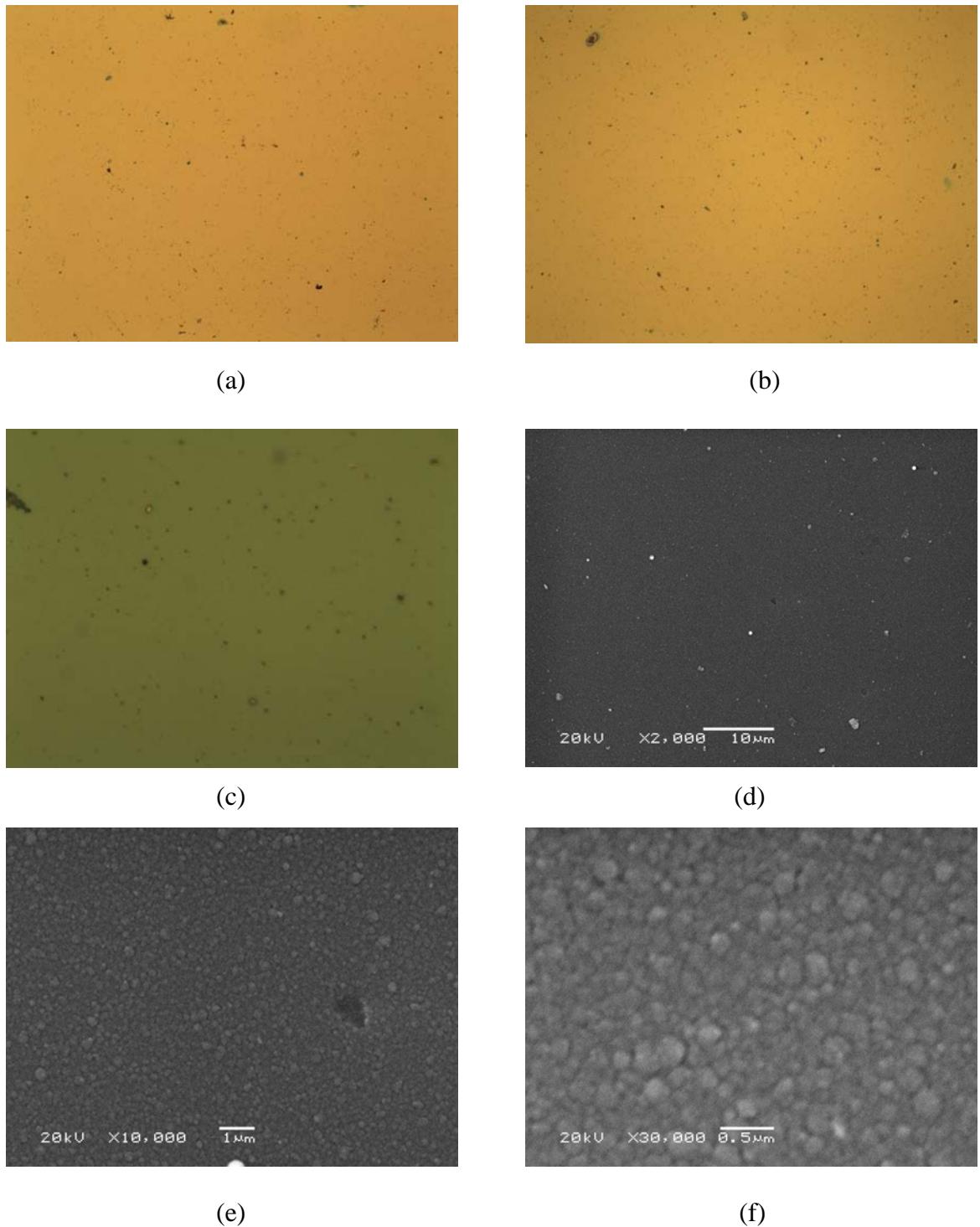


Figura A.2.6 - Imagens da amostra 24, obtidas pelas técnicas de microscopia óptica: (a) 50x; (b) 200x; (c) 1000x. E eletrônica: (d) 2000x; (e) 10000x; (f) 30000x

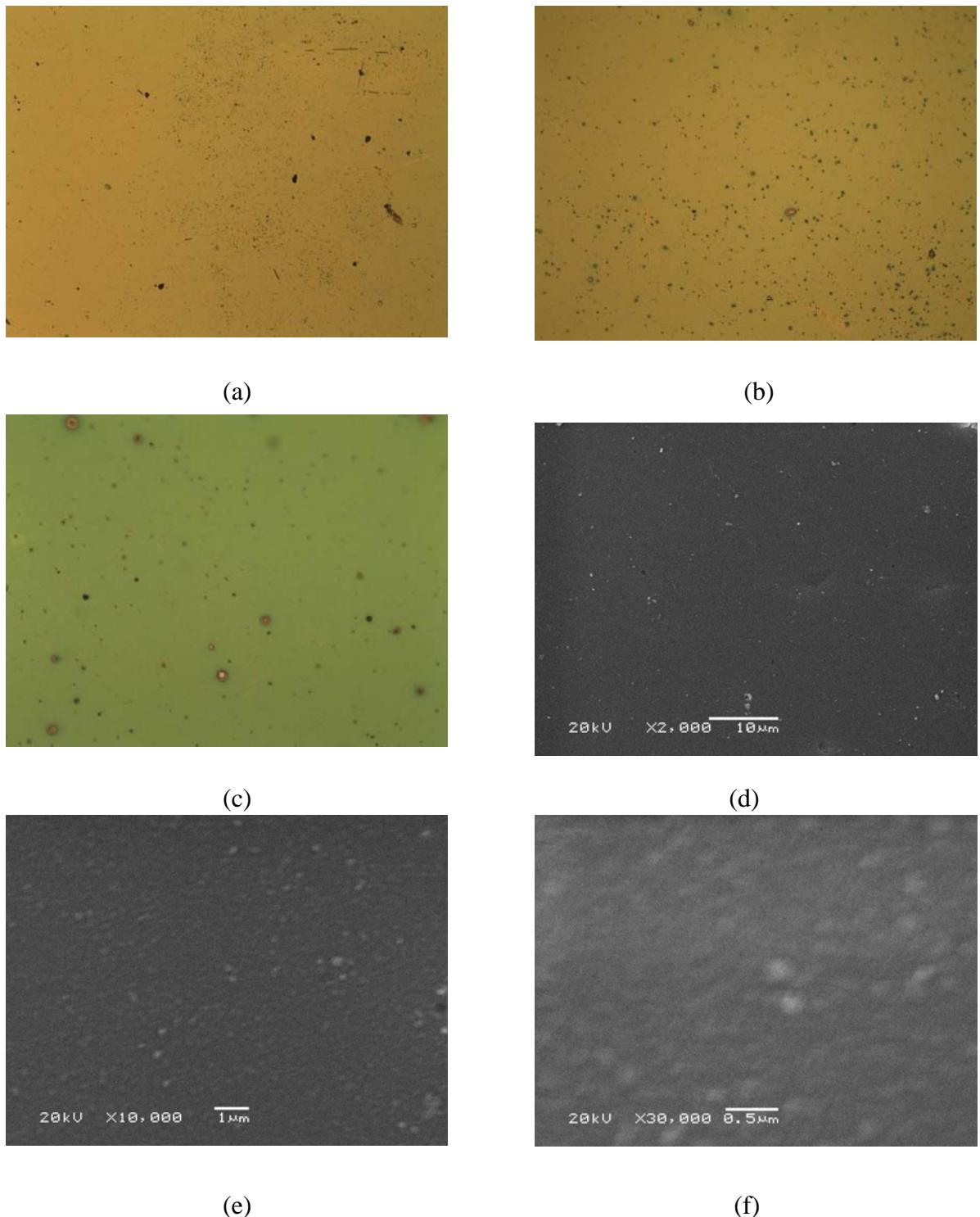


Figura A.2.7 - Imagens da amostra 25, obtidas pelas técnicas de microscopia óptica: (a) 50x; (b) 200x; (c) 1000x. E eletrônica: (d) 2000x; (e) 10000x; (f) 30000x